

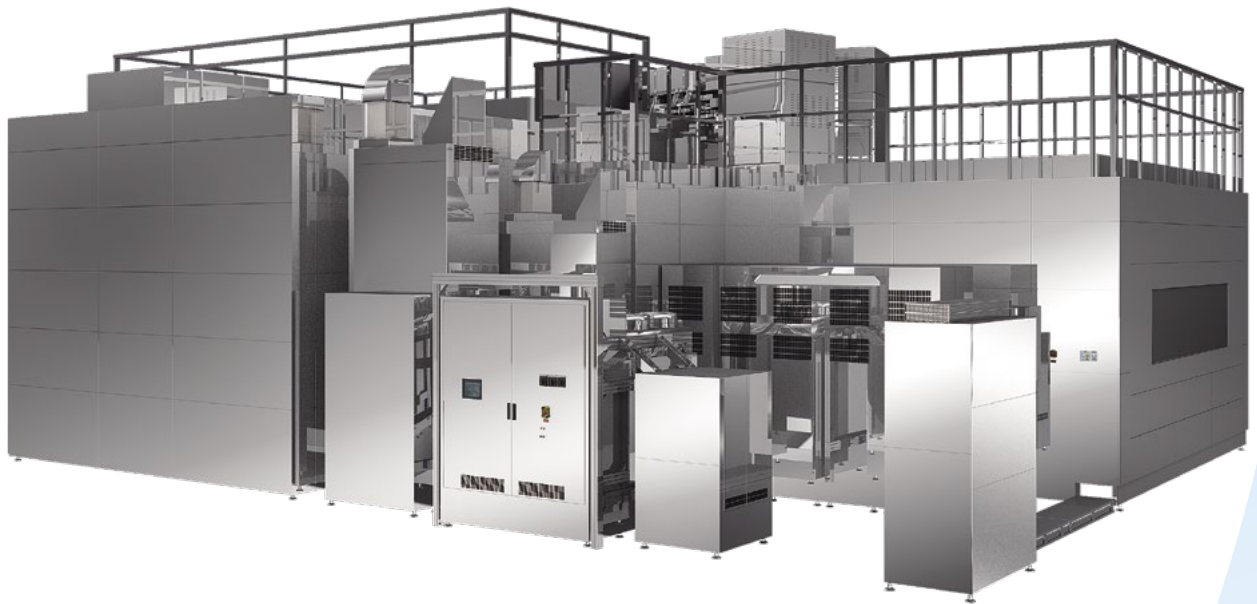


FPD露光装置

FX-86SH2/86S2

第8世代プレートサイズ対応

大型パネルの生産に最適なFPD露光装置



第8世代プレートサイズ対応 大型パネルの生産に最適なFPD露光装置

FPD露光装置 FX-86SH2/86S2

高精細パネルの生産に適したFX-67Sと、超大型プレートサイズに対応した当社第10世代装置の技術を融合し、高精細大型パネルの生産に対応。既存の第8世代装置に比べて、タクトタイムを短縮しました。FX-86SH2では、2.2 μm の高解像度も実現しています。

特長

●マルチレンズシステムを搭載

複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。広い露光領域を確保すると同時に、高解像度を達成。

●高解像度

マルチレンズシステムとニコン独自のフォーカス制御システムにより、プレート全面で高解像度を実現。FX-86SH2では、2.2 μm (L/S)の高解像度を達成しながら、広い実用焦点深度も同時に確保。

●高い重ね合わせ精度

新たに測長干渉計軸を増やし、位置計測システムを新設計したことにより計測安定性が向上し、 $\pm 0.5 \mu\text{m}$ の高い重ね合わせ精度を実現。

●高スループット

2,200 mm \times 2,500 mm プレートサイズの場合：
毎時587枚(46インチパネル)
毎時378枚(55インチパネル)

●露光性能の向上

独自技術により開発したさまざまなキャリブレーション機能を適用し、総合的により安定した露光性能を実現。

Performance

	FX-86SH2	FX-86S2
解像度 (L/S)	2.2 μm (g+h+i-line)	3.0 μm (g+h+i-line)
投影倍率	1:1	
重ね合わせ精度	$\leq \pm 0.5 \mu\text{m}$	
プレートサイズ	2,200 mm \times 2,500 mm	
タクトタイム	49 s/plate Conditions: 2,200 mm \times 2,500 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm ²	

レーザ光

ビームをのぞきこまないこと

Max. 1 mW CW He-Ne 633 nm

クラス2 レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本カタログに掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等（特定技術を含む）に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

- ・このカタログは2021年3月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。
- ・このカタログに掲載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

©2021 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

FPD装置事業部 営業部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 電話 (03) 6433-3641

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビル 電話 (03) 5762-8911

<https://www.nikon.co.jp/pec/>